

PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DAC E IMPEGNO 325/2022

VISTA la DAC prot.n.118597 del 20/04/2023, relativa alla fornitura di Sistemi per attacco al plasma Reactive Ion Etching (RIE) e Deep Reactive Ion Etching (DRIE), nella quale sono stati riportati errati: la definizione dell’attrezzatura da acquistare, i nominativi di supporto al RUP, l’importo a base di gara della fornitura, il contributo ANAC e l’importo per la pubblicità legale;

SI DISPONE

Di procedere alla rettifica nella DAC e dell’impegno in procedura Sigla n.325/2022 come segue:

- Fornitura di un Sistema di attacco al plasma a Ioni Reattivi CCP (CCP-RIE) e Un Sistema di attacco al plasma a Ioni Reattivi ICP (ICP-RIE);
- Commissione di supporto al RUP: Liborio Capozzo, ISSMC Faenza - matricola 5555, Nicoletta Randi, IMM Bologna – matricola 10949, Fabrizio Tamarri, IMM Bologna – matricola 855;
- Modifiche agli importi suddetti come da tabella seguente:

A1	Importo stimato posto a base della procedura	985.000,00 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	150,00 €
<b>A</b>	<b>Importo a base di gara (A1 + A2)</b>	<b>985.150,00 €</b>
B1	Opzioni di rinnovo	0,00 €
B2	Opzioni di proroga	0,00 €
B3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per le voci B1 e B2	0,00 €
<b>B</b>	<b>Importo altre voci (B1 + B2 + B3)</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>VALORE STIMATO DELL'APPALTO (A + B)</b>	<b>985.150,00 €</b>
C1	Spese per pubblicità legale (IVA esclusa)	5.000,00 €
C2	Contribuzione ANAC	410,00 €
<b>C3</b>	<b>Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (calcolati sulla voce A)</b>	<b>0,00 €</b>
C4	Spese per commissione giudicatrice	500,00 €
<b>C</b>	<b>Somme a disposizione (C1 + C2 + C3 + C4)</b>	<b>5.910,00 €</b>
D1	IVA (calcolata su C1)	1.100,00 €
D2	Eventuali altre imposte	0,00 €
<b>D</b>	<b>Somma imposte (D1 + D2)</b>	<b>1.100,00 €</b>
	<b>IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B + C + D)</b>	<b>992.160,00 €</b>

CNR IMM  
 Il Direttore  
 Dott. Vittorio Privitera